This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.





Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

11231250

PUBLICATION DATE

27-08-99

APPLICATION DATE

18-02-98

APPLICATION NUMBER

10054388

APPLICANT: CANON INC;

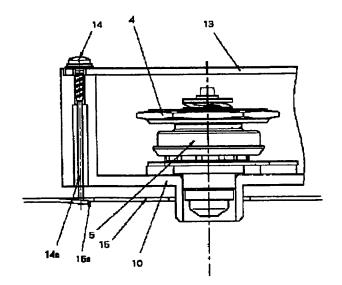
INVENTOR: TOMITA KENICHI;

INT.CL.

G02B 26/10 B41J 2/44

TITLE

SCANNING OPTICAL DEVICE



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a scanning optical device permitting to facilitate grounding inexpensively and easily without adding any special member for grounding.

SOLUTION: This device is a scanning optical device wherein it comprises a light source part, a deflector for deflecting a light flux from the light source part by rotating a deflection mirror 4 at a high speed with a scanner motor 5, etc., a lens, etc., for converging the light flux deflected by the deflector on a predetermined surface, and a metallic cap is fastened by screws 14 to an optics box incorporating them, and at least one of the screws has a shaft part which penetrates the optics box 10 and is abutted on the metallic optical base 15 grounded at the end, and when the above-mentioned scanning optical device is mounted on the optical base 15, the device is made up so that the metallic cap is grounded by the abutment of the shaft tip on the optical base 15.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-231250

(43)公開日 平成11年(1999)8月27日

(51) Int.Cl.⁸

識別配号

102

P I

G 0 2 B 26/10

102

G02B 26/10 B41J 2/44

B41J 3/00

D

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特麼平10~54388

平成10年(1998) 2月18日

(71)出顧人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 冨田 健一

部 链一

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

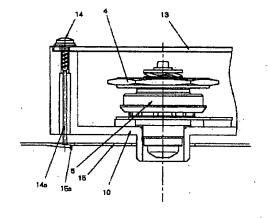
(74)代理人 弁理士 長尾 達也

(54) 【発明の名称】 走査光学装置

(57)【要約】

【課題】本発明は、特別な接地用部材を付加することな く、接地を安価で容易に行うことができる走査光学装置 を提供することを目的としている。

【解決手段】本発明は、光源部と、偏向ミラーをスキャナモータ等によって高速回転させ該光源部からの光束を偏向する偏向器と、該偏向器により偏向された光束を所定面上に集光するレンズ等を備え、これらを収納した光学箱に金属製の蓋をネシで固定してなる走査光学装置であって、該ネジの少なくとも1つは前記光学箱を貫通してその先端が接地された金属の光学台に当接する軸部を備え、該光学台に前記走査光学装置を取り付けた際、該軸部先端の該光学台への当接によって該金属製の蓋を接地するように構成したことを特徴とするものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】光源部と、偏向ミラーをスキャナモータ等 によって高速回転させ該光源部からの光束を偏向する偏 向器と、該偏向器により偏向された光束を所定面上に集 光するレンズ等を備え、これらを収納した光学箱に金属 製の蓋をネジで固定してなる走査光学装置であって、 該ネジの少なくとも1つは前記光学箱を貫通してその先 端が接地された金属の光学台に当接する軸部を備え、該 光学台に前記走査光学装置を取り付けた際、該軸部先端 の該光学台への当接によって該金属製の蓋を接地するよ 10 うに構成したことを特徴とする走査光学装置。

【請求項2】前記軸部先端は、円錐形状であることを特 徴とする請求項1に記載の走査光学装置。

【請求項3】前記軸部先端には、断面V字状の凹部が設 けられていることを特徴とする請求項1 に記載の走査光 学装置。

【請求項4】前記軸部には、一部に軸方向とほぼ垂直に 穴が設けられていることを特徴とする走査光学装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザビームプリ ンタ等においてレーザビーム偏向用に使用される偏向器 を備えた走査光学装置に関する。

[0002]

【従来の技術】図6に、従来例である走査光学装置の光 学系の構成を示す。図6において、光の進行方向に沿っ て説明すると、101は光源である半導体レーザであ る。単一の点光源からレーザ光は、発散しながら出射さ れるが、102のコリメータレンズを透過することで、 ズ102の近傍には、103の開口絞りがあり、その絞 り形状に従ってビーム形が決められる。この光ビーム は、104のシリンドリカルレンズを透過するととによ り、その一方向だけ収束作用をうけて105のポリゴン ミラー上に線状に集光される。ボリゴンミラー105 は、スキャナモータ106に固定されており、矢印a方 向に高速に回転している。ボリゴンミラー105の鏡面 105aで反射された光ビームはスキャナモータ106 の回転に伴って、高速に偏向走査される。さらに、光ビ から構成される f θ レンズを透過することにより、感光 体ドラム109上に微小なスポットに結像される。

[0003]また、 $f\theta$ レンズを透過することにより、 ポリゴンミラー105で等角速度で偏向走査された光ビ ームは、感光体ドラム109上で光スポットが等速度で 走査されるように変換される。光スポットは、感光体ド ラム109上を矢印b方向に繰り返し走査されるが、ポ リゴンミラー105の反射面の分割誤差があると、繰り 返して走査情報を書き込むタイミングがずれるために、

いる。画像非有効部の光ビーム110は、111の固定 ミラーで反射され、112の集光レンズを介して、11 3のタイミング検知用センサに導かれる。光学箱114 (不図示)は、以上示した走査光学装置の要素を収納し ており、光学箱114に蓋115(不図示)が取り付け られて走査光学装置が完成する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな走査光学装置において、近年は、より高精細でより 高速なプリンターの要求が強くなってきた。これに対応 するため、ポリゴンミラーをより高速回転させると、ポ リゴンミラーの有効反射面に外部から侵入した塵埃が付 着し、反射率が低下して画像に不良を生じる。そのため 更なる光学箱の密閉が要求されている。また、ポリゴン ミラーを高速回転させるととで騒音が大きくなる。騒音 の観点からも、更なる光学箱の密閉が要求されている。 【0005】蓋部材には、通常、樹脂成型品か金属板を 用いるが、蓋に金属を用いれば、樹脂成型品に比べ蓋の 反りによる光学箱との隙間を少なくでき、光学箱の密閉 20 性を上げることができる。しかしながら、走査光学装置 には、レーザユニットやスキャナモータ等高周波の信号 を取り扱う部材が含まれており、蓋が金属製であるとと の蓋がアンテナとなりここから外部へ電磁波を発生させ るいわゆる放射ノイズが問題となる。そのため、蓋を接 地する必要があり、従来においては、接地するためにア ース線やアース板が用いられていたが、これらはコスト が高く、また組み立て性が悪いという点等に問題があっ た。

【0006】そこで、本発明は、上記した従来のものに 発散光束から平行状態へと変換される。コリメータレン 30 おける課題を解決し、特別な接地用部材を付加すること なく、接地を安価で容易に行うことができる走沓光学装 置を提供することを目的とするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を達 成するために、走査光学装置をつぎのように構成したと とを特徴とするものである。すなわち、本発明の走査光 学装置は、光源部と、偏向ミラーをスキャナモータ等に よって高速回転させ該光源部からの光束を偏向する偏向 器と、該偏向器により偏向された光束を所定面上に集光 ームは107の球面レンズ、108のトーリックレンズ 40 するレンズ等を備え、これらを収納した光学箱に金属製 の蓋をネジで固定してなる走査光学装置であって、該ネ ジの少なくとも1つは前記光学箱を貫通してその先端が 接地された金属の光学台に当接する軸部を備え、該光学 台に前記走査光学装置を取り付けた際、該軸部先端の該 光学台への当接によって該金属製の蓋を接地するように 構成したことを特徴としている。また、本発明の走査光 学装置は、前記軸部先端が、円錐形状であるととを特徴 としている。また、本発明の走査光学装置は、前記軸部 先端には、断面V字状の凹部が設けられていることを特 各反射面で偏向走査された先頭部の光ビームを検知して 50 徴としている。また、本発明の走査光学装置は、前記軸

部には、一部に軸方向とほば垂直に穴が設けられている ことを特徴としている。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明は、上記したように、光学 箱に蓋を固定するためのネジの少なくとも1つが、光学 箱を貫通してその先端が接地された金属の光学台に当接 する軸部を備え、光学台に走査光学装置を取り付けた 際、軸部先端の光学台への当接によって金属製の蓋を接 地するように構成されているから、前記ネジを介して前 記蓋を容易に接地されることが可能となり、特別な接地 10 用部材を付加する必要はなく接地を安価で容易に行うと とができる。また、本発明においては、前記ネジ先端か ら伸びる軸部の先端形状を円錐形状とすることにより、 接地をより確実に行うことができる。また、本発明にお いては、前記ネジ先端から伸びる軸部の先端に断面V字 状の凹部を設けることでも、接地を確実に行うことがで きる。また、本発明においては、前記ネジの先端から伸 びる軸部の一部に軸方向とほぼ垂直に穴を設けるように するととによって、軸部先端が光学台に当接した際の光 学ステーからの反力を前記ネジの弾性変形で吸収して、 光学箱のゆがみ、すなわち光学特性の変化を低減すると とができる。

[0009]

【実施例】以下に、本発明の実施例について説明する。 [実施例1]本発明の実施例1を図1~図2を用いて説 明する。図2は、レーザビームブリンタにおいて用いら れ、感光体を光束によって走査するための、本発明にお ける実施例1の、走査光学装置の構成を説明する平面図 であり、走査光学装置に含まれる各構成部材の機能を説 明するための図である。図2にはその蓋11を取り除い 30 た平面図が示されている。走査光学装置は、光学箱1 0、半導体レーザ装置1、半導体レーザ装置1から発生 する光束を平行光束にするコリメータレンズ2、コリメ ータレンズ2からの平行光束を線状に集光するシリンド リカルレンズ3、シリンドリカルレンズ3によって集光 されてできる光束の線像の近傍に偏向反射面4 a を有す るポリゴンミラー4と、これを回転させる手段であるス キャナモータ5、 f θ レンズ6 等を含んで構成されてい る。偏向反射面4aにおいて偏向反射された光束は、f **θレンズ6を介して反射鏡7に入射し、反射鏡7におい 40** て反射されて、不図示の感光体を照射する。

【0010】 $f\theta$ レンズ6は、偏向反射面4aで反射される光束が感光体上においてスポットを形成するように集光され、また前記スポットの走査速度が等速に保たれるように設計されている。このような $f\theta$ レンズ6の特性を得るために、 $f\theta$ レンズ6は、球面レンズ6aとトーリックレンズ6 bの2つのレンズで構成されている。ポリゴンミラー4の回転によって、感光体においては光束による主走査が行われ、また感光体がその円筒の軸線まわりに回転駆動することによって副走査が行われる。

このようにして感光体の表面には静電潜像が形成される。図2に示すように、偏向走査装置の照射位置調整は、光学第10の箱枠の外側に設けた、位置決めピン8、9によって行われている。11は位置決めピン8のガイド孔、12は位置決めピン9のガイド孔である。偏向走査装置のx方向の照射位置調整は位置決めピン8 および9を共にx方向に沿って同じ向きに移動させることによって行われている。また、偏向走査装置のθ方向の調整は、位置決めピン8と位置決めピン9を、それぞれx方向に沿って逆の向きに移動させることによって、θ方向の回転移動を行う。

【0011】図1には、図2に示した走査光学装置に蓋 13が取り付けられた状態の要部断面図を示す。蓋13 はネジ14によって光学箱10に固定されている。 ネジ 14の先端には軸部14aが設けられている。走査光学 装置を光学台15に固定すると、軸部14 aは光学台1 5と当接する。光学台15は接地されており、ネジ14 と当接することにより、蓋13が接地されている。軸部 14aと光学台15の当接する部分には、切り欠き15 20 aが設けられている。これによって、走査光学装置が光 学台から反力を受けて光学特性が変化したり、光学箱1 0が変形し、蓋13と光学箱10の密着部分の一部が浮 き上がって防塵性能を損なうのを防止することができ る。切り欠き部15aは、軸部14aと当接すると弾性 変形するように構成されている。上記の方法により、部 品点数を増やすことなく金属材料の蓋を容易に接地する ことができる。本実施例においては、このように蓋を光 学箱に固定するネジを用いて、蓋を接地するようにした ものだが、全てのネジに接地作用をもたせる必要は無 い。場合によっては1本のみでも良い。また、何ヶ所か 接地させた方が良い場合には、最適な位置にある固定ネ ジを選択して接地作用をもたせても良い。

【0012】 [実施例2] 図3に本発明の実施例2を示す。実施例1と同一部材は同一番号にて示す。軸部14aの先端は円錐形状になっている。これによって光学台15との接地圧を上昇することができ、より確実に接地を実現することができる。

【0013】[実施例3]図4に本発明の実施例3を示す。実施例1と同一部材は同一番号にて示す。軸部14aの先端には断面V字状の凹部が設けられている。との方法でも光学台15との接地圧を上昇することができ、より確実に接地を実現することができるほか、突端部が無いので組み立て作業者の安全性も向上している。

【0014】[実施例4]図5に本発明の実施例4を示す。実施例1と同一部材は同一番号にて示す。軸部14aの一部には、軸方向とほぼ垂直な穴14bが設けられている。穴14bは光学台に接すると図5右のようにたわんで光学台15からの反力を吸収する。この方法では、光学台に穴を設けなくても良くなるので、光学台の50 剛性向上や、穴からの塵埃の進入の防止に寄与する。

[0015]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、光学箱 に蓋を固定するためのネジの少なくとも1つが、光学箱 を貫通してその先端が接地された金属の光学台に当接す る軸部を備え、光学台に走査光学装置を取り付けた際、 軸部先端の光学台への当接によって金属製の蓋を接地す るように構成されているから、前記ネジを介して前記蓋 を容易に接地されることが可能となり、特別な接地用部 材を付加する必要はなく接地を安価で容易に行うことが できる。また、本発明においては、前記ネジ先端から伸 10 部付近を説明する図である。 びる軸部の先端形状を円錐形状とすることにより、接地 をより確実に行うことができる。また、本発明において は、前記ネジ先端から伸びる軸部の先端に断面V字状の 凹部を設けることでも、接地を確実に行うことができ る。また、本発明においては、前記ネジの先端から伸び る軸部の一部に軸方向とほぼ垂直に穴を設けるようにす るととによって、軸部先端が光学台に当接した際の光学 ステーからの反力を緩和して、光学特性の変化や蓋の反 りを低減することができる。

【図面の簡単な説明】

*【図1】本発明の実施例1における、走査光学装置の接 地部付近を示す要部断面図である。

【図2】本発明の実施例1における、走査光学装置を説 明する図である。

【図3】本発明の実施例2における走査光学装置の接地 部付近を説明する要部断面図である。

【図4】本発明の実施例3における走査光学装置の接地 部付近を説明する要部断面図である。

【図5】本発明の実施例4における走査光学装置の接地

【図6】従来の走査光学装置を説明する断面図である。 【符号の説明】

4:ポリゴンミラー

5:スキャナモータ

6: f θ レンズ

10:光学箱

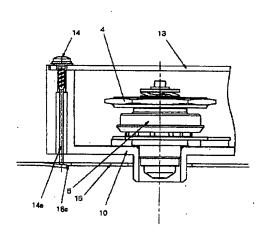
13:光学箱蓋

14:蓋固定ネジ

15: 光学台

***20**

【図2】



【図1】

